

# تهیه پوشش نیمه رسانا از نانو ورقههای گرافن سنتز شده با لیزر

### هاجر قنبری'، رسول صراف مأموری'، جمشید صباغزاده'، رسول ملکفر'

· دانشگاه تربیت مدرس، <sup>۲</sup> مرکز علوم و فنون پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی

rsarrafm@modares.ac.ir

#### ۱– مقدمه

گرافن، یک ورقه مسطح کربنی با ضخامت یک اتم، در شبکه هگزاگونال است که از قرار گرفتن چندین لایه آن در کنار هم به صورت فشرده نانوورقههای گرافن (ضخامت< ۱۰۰m) ایجاد میشود [۱]. این نانوورقهها، به دلیل ویژگی های مکانیکی و الکترونیکی عالی، در سالهای اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند [۲–۵]. این ماده تا کنون به روش های مختلفی تهیه شده [۶] که مهم ترین آنها شامل رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار [۷]، رشد همبافته [۸]، ورقه ورق ه کردن میکرومکانیکی [۳]، ورقه ورقه کردن در فاز مایع [۹،۱۰]، هیدروترمال [۱۱]، کاهش شیمیایی اکسیدگرافیت [۱۲]، ورقه ورقه کردن گرافیت روی سطح سیلیسیم [۱۳]، تبخیر Sic در خلاً (رشد حرارتی روی سطح Sic) [۱۴] می باشد. برای بهره گیری از رسانایی بالای این ماده در کنار قابلیت تهیه لایه نازک از آن معمولاً از روش کاهش شیمیایی اکسیدگرافیت استفاده میشود [۵] که علیرغم مزیت مضاعف امکان تهیه در مقیاس بالا، به دلیل تشکیل اگریگیتهای برگستان پذیر در هنگام کاهش از حالت اکسیدی، مشکلزا است. به همین دلیل از انواع روش های عاملدار کردن کوالانت و غیر کوالانت برای جلوگیری از رخداد این مشکل استفاده میشود [۱۵]. در حالی که با عامل دار کردن کوالانت و غیر کوالانت برای جلوگیری از رخداد این مشکل استفاده میشود [۱۹]. در حالی که با عامل دارکردن کوالانت و غیر کوالانت برای جلوگیری از رخداد این مشکل استفاده میشود [۱۹]. در حالی که با عامل دارکردن کوالانت معمولاً می توان سل های پایدارتری ایجاد کرد اما این روش به دلیل تشکیل پیوندهای غیرقابل برگشت پس از کاهش در قطعه نهایی خواص الکترونیکی را کاهش میدهد [۱۷]. از این رو تلاش میشود بیشتر، از عاملدارکردن غیرکوالانت برای کاربردهای مرتبط با خواص الکترونیکی بهره گرفته شود.

از طرف دیگر از میان منابع انرژی، لیزر، به عنوان منبع تولیدکننده نور و حرارت و با توجه به شرایط آن در گستره وسیعی از طول موج، پهنای پالس (در صورت استفاده از انواع پالسی)، انرژی وقابلیت تمرکز بر نقاط مورد نظر در چند مرحله مختلف از تهیه گرافن بکار رفته است اگرچه در مقایسه با سایر تکنیکهای سنتز مانند روشهایی که پیشتر ذکر شد چندان تاثیرگذار نبودهاست. از این جمله میتوان به سنتز نانوساختارهای گرافنی در خلا بر روی سیلیسوم به کمک لیزر[۸۸]، سنتز همبافته به کمک لیزر[۹۹]، استفاده از لیزر در فرایند کاهش اکسیدگرافیت،[۲۰،۲۱] الگودهی و انتقال گرافین به کمک لیزر [۲۲] و اخیراً سنتز نانودیوارههای گرافنی چندلایه در آب به کمک کندوسوز لیزری کربن [۳۳] اشاره کرد. در این کار، از روش کندوسوز لیزری فویل صنعتی گرافیتی به کمک لیزر پالسی Q-switched Nd:YAG در محیط (پروپانول بهره گرفته شده تا با تهیه مستقیم نانوورقههای گرافن غیراکسیدی، نیازی به اعمال فرآیند کاهش نباشد. هـم چنین با توجه به سنتز مستقیم در محیط مایع و استفاده از یک پراکندهساز تجاری، سوسپانسیون نسبتاً پایداری تهیه شد و خواص آن مورد بررسی قرار گرفت.

برای مشخصهیابی پوششهای گرافن که با توجه به نوع کاربرد به روشهای مختلف سنتز می شوند از روشهای آنالیز مختلفی استفاده می شود. برای مشاهده ساختار مورفولوژیکی سطحی لایه از انواع روشهای میکروسکوپی مانند AFM، SEM، MOM استفاده شده است [۱۵٬۲۵] و برای اندازه گیری استفاده شده است [۱۵٬۲۴]. به کمک طیفنگاری رامان و XRD و XPS آنالیز ساختاری انجام گرفته [۱۵٬۲۵] و برای اندازه گیری رسانایی الکتریکی آنها معمولاً از روش چهار نقطه ای استفاده می شود [۲۶٬۲۷].

# ۲- آزمایشات تجربی

در این کار از روش انفجار لیزری برای تورق گرافیت صنعتی (flexible graphite) استفاده شد[۲۸–۳۰]. ابتدا برشی از ورقه گرافیت صنعتی در کف ظرف حاوی (پروپانول تحت تابش اشعه لیزر VAG Nd:YAG با ۹۵ مکنده در یکسو و لوله FWHM=۲۴۰ns در داخل محفظه محافظ قرار گرفت. محفظه محافظ که دارای یک درب کناری، لوله مکنده در یکسو و لوله ورودی در محل ورود پرتوی لیزر است، جهت انتقال بخارات سمی حلالها به خارج از محیط آزمایشگاه طراحی و ساخته شد (شکل ۱). نرخ تکرار پالس ۲۴۸۲ و انرژی mJ/pulse بخارات سمی حلالها به خارج از محیط آزمایشگاه طراحی و ساخته شد (شکل ۱). نرخ تکرار پالس ۲۲۸۲ و انرژی mJ/pulse بخارات سمی حلالها به خارج از محیط آزمایشگاه طراحی و ساخته شد (مکل ۱). نرخ تکرار پالس ۲۲۸۲ و انرژی MJ/pulse و دوی گرافیت با شدت ۷/۲۵۰ سازم در اندازه تمرکز (مر ایران ایران ایران ایرون ۱۹۹٪, even منظور رسیدن به کمینه مقدار ماده لازم جهت انجام آنالیز، با تکرار ۱۰ بار انجام گرفت. حلال ۱پروپانول (۹۹٪, nole طواحه وی ورقه گرافیت پوشانده شود. در اثر تابش لیزر و ورود ذرات به حلال، مر بار سنتز چنان اضافه شد که ارتفاعی معادل ماه ۱۰۹۳ روی ورقه گرافیت پوشانده شود. در اثر تابش لیزر و ورود ذرات به حلال، رنگ حلال به مرور تیره تر شد و سوسپانسیون غیرپایداری تشکیل شد. این سوسپانسیون پس از خارج کردن گرافیت تحت رنگ حلال به مرور تیره تر شد و سوسپانسیون غیرپایداری تشکیل شد. این سوسپانسیون په از خارج کردن گرافیت تحت التراسونیک (how,۱۰۹۳)، ۲۰۰۲/۲۵۲۹، ۲۰۰۲) (۲۰ دقیقه) قرار گرفت و به مدت ۲۴ ساعت بی حرکت نگه داشته شد. پس از تهنشینی خودبهخودی (۱روز)، حدود ۸۰ درصد از بالای سوسپانسیون به کمک پیپت انتخاب و ماده جامد آن با استفاده از سانتریفوژ (i cFc free۳۰۰۰MISTRAL) در سرعت ۳۰۰۰rpm جدا و از طریـق افـزودن اتـانول شـسته و بـا پراکندهسازی مجدد در اتانول (التراسونیک،۳۰ دقیقه)، همچنین زماندهی جهت رسوبدهی، رسوب آن مجدداً جدا شـد. رسـوب حاصل در دمای ۲۰۰۵ به مـدت ۳ سـاعت در خـشک کـن (MEMMERT, VO۴۰۰) قرارگرفتـه و طـی تغلیظ بـه غلظـت Sodium Salt of polymerized naphthalene DEKAMOL PES (Sodium Salt of polymerized naphthalene DEKAMOL PES) در اتانول رسید. در گام بعد، محلول آبی Sodium Salt of polymerized naphthalene DEKAMOL PES (Sodium salt of polymerized naphthalene کـن (۸۳<sup>3</sup> برای تهیه سل پایدار از محـصول تغلیظ شـده (page به عنوان پراکنده ساز تجاری با غلظت ۲۵molar به میزان ۸۰cm<sup>3</sup> برای تهیه سل پایدار از محـصول تغلیظ شـده تهیه شد. محلـول آبـی فـوق، بـه ۲۰۲۰ از سوسپانـسیون کلوئیـدی گـرافن افـزوده و سوسپانـسیون پایـداری از آن تهیـه شـد (التراسونیک، ۳ ساعت). از نمونه فوق برای MEM و از خشک شده آن روی پایه سیلیکون بـرای Mac و MEX و ابعـاد سوسپانـسیون فـوق بـا اسـتفاده از روش پوشـشدهـی چرخـشی بـر روی لامـلهـایی بـا ضـخامت ۸۰۰۷۰ و ابعـاد



شکل ۱ – شماتیک دستگاه Q-switched Nd:YAG laser و نحوه قراگیری ظرف حاوی گرافیت و نحوه تابش اشعه لیزر و محل محفظه محافظ خارج کننده گازهای سمی. در تصویر بالا سمت چپ عکس دستگاه لیزر مورد نظر نشان داده شده است.

برای لایه نشانی سوسپانسیون کلوئیدی گرافن به روش پوششدهی چرخشی، از دستگاه دست ساز استفاده شد. شرایط سنتز در جدول ۱ نشان داده شدهاست. پس از خشک کردن لایه ها در خشک کن (۳ ساعت، ۲۰°۲)، رسانایی آنها با دستگاه I-V meter Keithley اندازه گیری شد. برای این کار ۲ پروب دستگاه فوق با فاصله ۱۳m از هم بر روی سطح لایه قرار گرفته و با اعمال ولتاژ ۱۰۷–تا ۱۰۷، جریان در ۳ نقطه مختلف نمونه اندازه گیری شد. در نهایت با رسم نمودار ولتاژ بر حسب جریان و انطباق خط I-V بر آن از طریق محاسبه شیب نمودار مقاومت بالک محاسبه شد.

سیکل لایه نشانی	تعداد قطره	کد نمونه
0.00	١	١
	١	۲
500 0 3	١	٣
100 4	١	۴
100 0 200	۴	۵
$0 \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 100 \\ 0 & 100 \\ 0 & 100 \\ 0 & 100 \\ 0 & 200 \end{bmatrix}$	۴	۶

جدول ۱ - شرایط لایه نشانی نمونهها؛ قطرات و سیکل لایه نشانی

### ۳– نتایج و بحث

در شکل ۲-الف و ۲-ب تصاویر SEM سل پایدار (بر روی ویفر سیلیکون) بدون پوشش طلا به ترتیب در بزرگنمایی کم و زیـاد مشاهده می گردد. همانطور که در شکل ۲-الف نشان داده شده است محصولات دارای مورفولوژی ورقه ای شکل هستند که عمدتاً به صورت موازی با سطح ویفر بر روی آن قرار گرفتهاند. اندازه طولی ورقهها کمتر از ۱۰μm میباشـند کـه اغلـب درهـم فرورفتهاند. در شکل ۲–ب سطح یکی از ورقهها نشان دادهشدهاست که در بعضی نقاط چروکیدهاست. در تصویر الحاقی ایـن شکل سطح مقطع یکی از برای بررسی بیشتر ساختارورقهها، تصاویر TEM این ورقهها نشان داده شده که اندازه گیری حدودی بر روی آن عدد ۲۳nm را نشان میدهد. اندازهگیری بر روی تعداد زیادی از ورقهها نیز نشان داد که ضخامت آنها کلاً کمتـر از ۱۰۰nm میباشد. در شکل ۲-ج تصویر چند ورقه در بزرگنمایی کم دیده می شود. در شکل ۲-د الگوی پراش ناحیه محدود (SADP) از سطح یک ورقه گرفته شده است که به وضوح حضور ساختار تک بلور هگزاگونال در آن را تأیید می کند. شمارش تعداد لایهها در تصاویر TEM نشان داد که تعداد ورقهها بین ۲ تا ۱۰ لایه متغیر است. در تصویر ۲-ه سطح مقطع یکی از این ورقهها با ۴ لایه، نشان داده شده است. در تصویر ۲-هـ الحاقي يک دسته ذرات كـروى شـكل و اغلـب بـه صـورت أگلـومره و زنجیره ذرات مشاهده می گردد. این ذرات بر روی بسیاری از ورقهها قابل رویت هستند. این ذرات در تصاویر TEM قبل از افزودن پراکنده ساز نیز مشاهده شدند و بررسی آنها با استفاده از روش طیف سنجی افت انرژی (EELS) تنها حضور فاز کربن را در آنها نشان داد. برای بررسی ضخامت این ورقهها سطح مقطع تعداد زیادی از ورقهها بررسی شد. و نـشان داد کـه ضـخامت آنها بین ۲ لایه تا ۱۰ لایه (۳/۵nm تا ۰/۳۴nm) متغیر است. اگرچه بعضاً ورقههای ضخیم نیز وجود دارند. یک لایه بی شکل (آمورف) بر روی اغلب ورقهها قابل تشخیص است. در تصویر ۲–و سطح مقطع چند ورقه دیده می شود. در بالای تصویر، گرافنی با تعداد لایههای بالاتر از ۱۰ لایه که به دو بخش تقسیم شدهاند و در پایین تصویر، یک نانوورقه گرافن دولایه خمیده قابل رویت است. فاصله میان صفحات گرافن ورقههای از ۲ لایه بالاتر که با اندازه گیری بر روی تصاویر TEM انجام گرفته عدد ۰/۳۵nm را نشان میدهد درحالی که این عدد در مورد انواع ۲لایه ۰/۴nm می باشد.



شکل ۲- تصویر محصول سنتز شده و پراکنده شده در محلول آبی DEKAMOL PES، الف) SEM در بزرگنمایی کم، ب) SEM در بزرگنمایی بالا، (الحاقی: اندازه گیری ضخامت ورقه)، ج) TEM در بزرگنمایی کم، د) الگوی پراش ناحیه محدود یکی ازورقهها در جهت [۰۰۲]، هـ) سطح مقطع یک ورقه با ضخامت ۴ لایه (فاصله بین لایهای ۰/۳۵nm)، تصویر الحاقی: تصویر زنجیر متشکل از ذرات بهم پیوسته و ذرات کروی به صورت آگلومره)، و) تصویر TEM سطح مقطع چند ورقه که در کنار همدیگر قرار گرفتهاند.



شکل ۳– الگوی پراش اشعه x نانوورقههای گرافن الف) قبل از افزودن پراکنده ساز و ب) بعد ازافزودن پراکنده ساز

برای بررسی فازهای حاضر در محصول، نتایج XRD قبل و پس از استفاده از پراکندهساز و انجام عملیات التراسونیک مقایسه شد. در هـ ر دو حالـت، فازهـای قابـل مـشاهده گرافیـت بـا سـاختار هگزاگونـال و کـربن بـا سـاختار بلـورین نـامعلوم (ICSD code: 460943)، کربولیت (ICSD code: 500926) هستند. فاز گرافیـت مربـوط بـه ورقـههـای مـشاهده شـده در تصاویر TEM و فاز کربن احتمالاً مربوط به ذرات کروی شکلی است که بر روی ورقهها به صورت آگلومره دیده میشوند. پس از افزودن پراکندهساز، علاوه بر فاز قبلی فازی اسیدی حاصل از انحلال پراکندهساز در آب نیز ایجاد شدهاست کـه هـم پوشـانی زیادی بر روی فاز کربنی دارد. این فاز پایه سدیمی Ics مناز انحلال پراکندهساز در آب نیز ایجاد شدهاست کـه هـم پوشـانی پراکنده شده هستند. اما در مورد تغییرات فازی اسیدی حاصل از انحلال پراکندهساز در آب نیز ایجاد شدهاست کـه هـم پوشـانی پراکنده شده هستند. اما در مورد تغییرات فازی ایجاد شده در نانوورقههای گرافن، از طریق انـدازهگـری پهنـای پیـک (۰۰۰) در نصف ارتفاع ( ۲٫۰<sub>۸</sub>) و استفاده از رابطه معروف دبـای شـرر (β ۲۰۹ ۲) / (۸×۹/۰) = t و لحـاظ ایـن رابطـه (۲) در ۱۰) در شد[۳۸]. تعداد ورقهها (n) (۲ا<n<۱۲ اول و (۱۱<-۱۲>۱۲) در حالت (د حالت دوم می.باشد. این نتیجه نشان میدهد که تفاوت چندانی در ضخامت ورقهها ایجاد نشده درحالی که سل نسبتاً پایداری از طریق وارد شدن پراکندهساز ایجاد شدهاست.

در ادامه، وضعیت توپولوژی سطح لایههای تهیه شده از سل پایدار فوق بر روی لامل با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نوری در بزرگنمایی های مختلف بررسی شد. در شکل ۴–الف که مربوط به نمونه تهیه شده بدون اعمال سرعت است، جزایر متـشکل از ورقهها تا حدی متصل هستند. اما سطح غیریکنواخت آن حتی بدون استفاده از میکروسکوپ نیز قابل رویت است. درحالی که در نمونه ۲ که در سرعت ۲۰۰۳ و با ریزش ۱ قطره تهیه شدهاست (شکل۴–ب) جزایر به صورت ایزولـه و از هـم جـدا بـدون اتصال دیده میشوند. در نمونه ۳ که در سرعت ۲۰۳۳ و همان تعداد قطره تهیه شده (شکل ۴–ج) علیـرغم پوشـیدگی سطح بیشتری از نمونه با جزایر متشکل از ورقهها، همچنان اتصالات کمی میان جزایر در نمونه دیده مـیشود و در حقیقـت شـبکهای متصل از ورقهها در نمونه و در منونه ۴ که سـرعت در آن بـه ۲۰۰۳ کـاهش یافتـه، همـانطور کـه در شـکل ۴– مشخص است، میزان اتصالات افزایش یافته و سطح بیشتری از نمونه نیز با ورقهها پوشیده شده است. در نمونه ۵ و ۶ کـه درآن تعداد قطرات بیشتر شده، و به ترتیب در سرعت ۱۰۰۳۲۳ و همای ۲۰۰۳ تهیه شدند، به وضوح سطح بیـشتری از نمونـه یوشـیده از ورقهها ست در عین اینکه اتصالات میان آنها نیز بیشتر شده به طوری که به ویژه در نمونه ۶ کاملاً سطح پوشیده از ورقهها ست در عین اینکه اتصالات میان آنها نیز بیشتر شده به طوری که به ویژه در نمونه ۶ کاملاً سطح پوشیده از متصل بههم هستند.



شکل ۴– تصاویر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ۵۰۰ برابر نمونههای الف) ۱، ب)۲، ج)۳، د)۴، ه)۵، و)۶

جدول ۲– مقادیر اندازهگیری شده مقاومت لایهها								
گرافیت صنعتی اولیه	۶	۵	۴	٣	٢	١	کد نمونه	
۵/۸×۱۰ <sup>۲</sup>	۱/۱۱×۱۰ <sup>۵</sup>	۱/۶۵×۱۰ <sup>۵</sup>	1,74×1.^	۱/•۶×۱۰ <sup>۹</sup>	۷/۷۸×۱۰ <sup>۹</sup>	-	مقاومت (Ω)	

در بررسی مقادیر اندازه گیری شده مقاومت، در مورد نمونه ۱ با توجه به عدم ایجاد سطح یکنواخت اندازه گیری بدون معناست. اما در نمونه شماره ۲ بالاترین عدد مقاومت دیده می شود که با توجه به تصاویر میکروسوپی و عدم تشکیل ساختار یکنواخت و به هم متصل، این عدد معقول بهنظر میآید. اما در نمونه ۳ با توجه به گستردگی بیشتر ورقهها در سطح نمونه در مقایسه با نمونـه ۲، کاهش مقاومت منطقی به نظر میرسد، درحالی که مرتبه مقاومت تغییر نکرده است که میتوان آن را به عدم تـشکیل شـبکه سطحی متصل بههم از ورقهها مرتبط دانست. این روند کاهش مقاومت همزمان با کاهش سرعت در نمونه ۴ نیـز ادامـه دارد بـه طوری که رسانایی در آن افزایش مییابد؛ اما، همچنان تغییر قابل ملاحظهای در مرتبه مقاومت دیده نمیشود که میتوان آن را نیز به وضعیت سطح لایه مرتبط دانست. همانطور که در تصاویر میکروسکوپ نوری مشخص شدهاست در ایـن نمونـه بـا وجـود گستردگی بیشتر سطح جزایر پوشاننده، همچنان تمام مناطق رسانا به هم متصل نیستند و بعضاً مناطقی بـه صـورت ایزولـه نیـز مشاهده می شود. اما در نمونه ۵ و ۶ با افزایش تعداد قطرات یا به عبارتی میزان ماده، مرتبه مقاومت ۴ بار کاهش می یابد که به وضوح با تغییر وضعیت اتصال ورقهها قابل توجیه است. در نمونه ۵ و ۶ کاملاً مناطق رسانا به هم متصل هستند که نتیجه آن تغییر واضح مرتبه مقدار مقاومت میباشد. سرعت لایهنشانی در نمونه ۶ دو برابر سرعت در نمونه ۵ میباشد. به نظر میآیـد ایـن افزایش سرعت در عین عدم جلوگیری از تشکیل لایه رسانای متصل، به یکنواختی بیشتر سطح و افزایش پوشیدگی بیشتری از سطح با لایه رسانا کمک کرده و باعث کاهش مقاومت تا ۶۰٪ شده است. اما برای بررسی دقیق تر این تفاوت، تـصاویر SEM این دو نمونه نیز در بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر (شکل۵-الف و ۵-ب به ترتیب) بررسی و با SEM سطح گرافیت صنعتی (شکل۵-ج) مقایسه شد. آنچه مشخص است مساله عدم ارتباط تمام نواحی رسانا در نمونه ۵ میباشد. در حقیقت در این نمونه مناطق رسانای کوچکی وجود دارند که با سایر مناطق ارتباط ندارند که البته در بزرگنمایی میکروسکوپ نوری قابل مشاهده نبودند. اما در نمونـه ۶ تمامی این مناطق به دلیل اتصالات مناسب در رسانایی شرکت میکنند. مقایسه این عدد با عدد مقاومت گرافیت صنعتی در نمونه اول نشان دهنده ۳ مرتبه افزایش مقاومت نسبت به گرافیت اولیه است.



شکل ۵- تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه الف)۵ و ب)۶ و ج) گرافیت صنعتی اولیه

اما علت تفاوت معنادار رسانایی این لایه با رسانایی بالای گرافن را میتوان به چندین مساله ارتباط داد: ۱)کیفیت گرافن تهیه شده به این روش: رسانایی بالای ذکر شده در منابع مربوط به تک لایه ایده آل گرافن می باشد[۳۳] درحالی که ما در این نمونه با انواع تکلایه سروکار نداریم و محصول از انواع چندلایه است. ۲) علیرغم اینکه گرافن چندلایه مادهای شبه فلز است، رسانایی پوششهای حاصل در محدوده مواد نیمرسانا قرار گرفته است. این درحالی است که با ورود عیوب ساختاری و ناخالصیها که طی مراحل سنتز گرافین و پراکندهسازی و البته تهیه لایه وارد شده است این مقدار کاهش می یابد [۳۳،۳۴]. در واقع گرافن تهیه شده به این روش حاصل انفجار لیزری بر روی سطح ورقه گرافیت صنعتی منعطف (exfoliated graphite) می باشد. این مسأله چون همراه با کندوسوز لیزری گرافیت صنعتی همراه با ۴٪ ناخالصی همراه آن می باشد منجر به ورود ناخالصیها ک نامطلوب نیز در کنار ورقهها می شود که تلاش شده طی مراحل مختلف سنتز حتی المقدور از سیستم خارج شود. اما هم چنان کربولیت (به عنوان محصول کندوسوز گرافیت و فازی بسیار عایق) در کنار نانوذرات کربنی در نهایت حضور دارند. این مساله خود باعث کاهش رسانایی است. دیگری حضور ناخالصی ناشی از ورود پراکنده ساز به عنوان یک ساختار پایه نفت الینی با خاصیت عایق بودن بالا خود عاملی در کاهش رسانایی است. ۳) اما در مورد پوششها کلاً مسأله متفاوت از انواع تک ورقه است. همچنین کیفیت و ضخامت پوشش در بحث لایههای گرافنی با توجه به نوع کاربرد بسیار تأثیرگذار است. ۳) نحوه اندازه گیری خواص در ورش مناسب برای اندازه گیری خواص لایه ها استفاده از روش چهارنقطهای است که متأسفانه دستگاه مورد نظری که امکان روش مناسب برای اندازه گیری خواص لایه ها استفاده از روش چهارنقطهای است که متأسفانه دستگاه مورد نظری که امکان استفاده از آن مهیا شد دقت لازم برای اندازه گیری خواص تمامی نمونهها را نداشت. از همین رو از math در آل ساده برای این استفاده شد که در واقع بیشتر، از آن برای مقایسه مقاومت بالک لایهها میوان است. ۳) نحر و انداز می این

## ۴- نتیجهگیری

می توان از نانوورق های گرافن سنتز شده از طریق ورق هورق ه کردن گرافیت صنعتی به کمک لیزر پالسی Q-switched Nd:YAG، با استفاده از پراکنده ساز صنعتی DEKAMOL PES سل پایدار تهیه کرد. لایه نیمرسانایی متشکل از این ورقه های رسانا را می توان به روش پوشش دهی چرخشی با ضخامت حدود ۲µ۳–۱ از سل پایدار آن ایجاد نمود. این موضوع تنها تأییدی بر سنتز نانوورقه های گرافن رسانا و نه انواع نانورقه های اکسیدگرافن نارسانا به کمک ورقه ورقه کردن لیزری می باشد. در حالی که به دلیل حضور همزمان ناخالصی های مختلف ناشی از روش سنتز در کنار نانوورقه های گرافن این روش ب عنوان روشی مناسب جهت تهیه لایه های رسانا پیشنهاد نمی شود. تنها ناخالصی همراه این ورقه ها ذرات کروی کربن هستند. علیرغم حضور غالب نانوورقه هایی با تعداد لایه کمتر از ۵، به دلیل حضور ورقه های بعضاً ضخیم تر، میانگین تعداد ورق ها

# ۵- تشکر و قدردانی

بر خود لازم میدانیم که از آزمایشگاه فرآوری مواد مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران بابت همکاری جهت استفاده از لیزر، آزمایشگاه نیمههادی مرکز ملی علوم و فنون لیزربابت همکاری جهت تهیه لایههای نازک و آزمایشگاه لایه نازک دانشکده برق پردیس فنی دانشگاه تهران بابت همکاری جهت استفاده از دستگاه اندازه گیری Kithley V-I meter تشکر و قدردانی نماییم.

- Jang, B. Z., & Zhamu, A. (2008), Processing of Nanographene Platelets (Ngps) and Ngp Nanocomposites: A Review. J. Mat. Sci., 43, 5092-5105.
- [2] Geim, A. K. (2009), Graphene: Status and Prospects. sceince, 324(5934), 1530-1534.
- [3] Geim, A. K., & Novoselov, K. S. (2007), The Rise of Graphene. Nat. Mater., 6(3), 183-191.
- [4] Rao, C. N. R., Biswas, K., Subrahmanyam, K. S., & Govindaraj, A. (2009), Graphene, the New Nanocarbon. J. Mater. Chem., 19(17), 2457-2469.
- [5] Kuilla, T., Bhadrab, S., Yaoa, D., Kimc, N. H., Bosed, S., & Leea, J. H. (2010), Recent Advances in Graphene Based Polymer Composites. *Prog. Polym. Sci.*, 35, 1350-1375.
- [6] Choi, W., Lahiri, I., Seelaboyina, R., & Kang, Y. S. (2010), Synthesis of Graphene and Its Applications: A Review. *Crit. Rev. Solid State*, 35(1), 52-71.
- [7] Xianbao, W., Haijun, Y., Fangming, L., Mingjian, L., Li, W., Shaoqing, L., Qin, L., Yang, X.,
  Rong, T., Ziyong, Y., Dong, X., & Jing, C. (2009), Large-Scale Synthesis of Few-Layered
  Graphene Using Cvd. *Chem. Vap. Deposition*, 15(1-3), 53-56.
- [8] De Heer, W. A., Berger, C., Wu, X., First, P. N., Conrad, E. H., Li, X., Li, T., Sprinkle, M., Hass, J., Sadowski, M. L., Potemski, M., & Martinez, G. (2007), Epitaxial Graphene. *Solid State Commun.*, 143(1-2), 92-100.
- [9] Lotya, M., Hernandez, Y., King, P. J., Smith, R. J., Nicolosi, V., Karlsson, L. S., Blighe, F. M., De, S., Wang, Z., Mcgovern, I. T., Duesberg, G. S., & Coleman, J. N. (2009), Liquid Phase Production of Graphene by Exfoliation of Graphite in Surfactant/Water Solutions. *J. Am. Chem. Soc.*, *131*(10), 3611-3620.
- [10] Hernandez, Y., Nicolosi, V., Lotya, M., Blighe, F. M., Sun, Z., De, S., Mcgovern, I. T., Holland, B., Byrne, M., Gun'ko, Y. K., Boland, J. J., Niraj, P., Duesberg, G., Krishnamurthy, S., Goodhue, R., Hutchison, J., Scardaci, V., Ferrari, A. C., & Coleman, J. N. (2008), High-Yield Production of Graphene by Liquid-Phase Exfoliation of Graphite. *Nat. Nanotechnol.*, 3(9), 563-568.
- [11] Yuan, C., Hou, L., Yang, L., Fan, C., Li, D., Li, J., Shen, L., Zhang, F., & Zhang, X. (2011), Interface-Hydrothermal Synthesis of Sn3s4/Graphene Sheet Composites and Their Application in Electrochemical Capacitors. *Mater. Lett.*, 65(2), 374-377.

جلد ۲ شمارهی ۲ تابستان ۱۳۹۲ 🌱

- [12] Ritter, K. A., & Lyding, J. W. (2008), Characterization of Nanometer-Sized, Mechanically Exfoliated Graphene on the H-Passivated Si(100) Surface Using Scanning Tunnelling Microscopy. *Nanotechnology*, 19, 015704.
- [13] Novoselov, K. S., Jiang, D., Schedin, F., Booth, T. J., Khotkevich, V. V., Morozov, S. V., & Geim, A. K. (2005), Two-Dimensional Atomic Crystals. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, 102(30), 10451-10453.
- [14] Z. Goknur Cambaza, Gleb Yushinb, Sebastian Osswalda, Vadym Mochalina, & Gogotsia, Y.
  (2008), Noncatalytic Synthesis of Carbon Nanotubes, Graphene and Graphite on Sic. *Carbon*, 46, 841-849.
- [15] Eda, G., & Chhowalla, M. (2009), Graphene-Based Composite Thin Films for Electronics. Nano Lett., 9(2), 814-818.
- [16] Bai, H., Xu, Y. X., Zhao, L., Li, C., & Shi, G. Q. (2009), Non-Covalent Functionalization of Graphene Sheets by Sulfonated Polyaniline. *Chem. Commun.*(13), 1667-1669.
- [17] Shen, J., Li, N., Shi, M., Hu, Y., & Ye, M. (2010), Covalent Synthesis of Organophilic Chemically Functionalized Graphene Sheets. J. Colloid Interface Sci., 348(2), 377-383.
- [18] Cappelli, E., Orlando, S., Servidori, M., & Scilletta, C. (2007), Nano-Graphene Structures Deposited by N-Ir Pulsed Laser Ablation of Graphite on Si. *Appl. Surf. Sci.*, 254, 1273-1278.
- [19] Lee, S., Toney, M. F., Ko, W., Randel, J. C., Jung, H. J., Munakata, K., Lu, J., Geballe, T. H., Beasley, M. R., Sinclair, R., Manoharan, H. C., & Salleo, A. (2010), Laser-Synthesized Epitaxial Graphene. ACS Nano, 4(12), 7524-7530.
- [20] Sokolov, D. A., Shepperd, K. R., & Orlando, T. M. (2010), Formation of Graphene Features from Direct Laser-Induced Reduction of Graphite Oxide. J. Phys. Chem. Lett., 1(18), 2633-2636.
- [21] Abdelsayed, V., Moussa, S., Hassan, H. M., Aluri, H. S., Collinson, M. M., & El-Shall, M. S. (2010), Photothermal Deoxygenation of Graphite Oxide with Laser Excitation in Solution and Graphene-Aided Increase in Water Temperature. J. Phys. Chem. Lett., 1(19), 2804-2809.
- [22] Oh, J.-S., Kim, S.-H., Hwang, T., Kwon, H.-Y., Lee, T. H., Bae, A.-H., Choi, H. R., & Nam, J.-D. (2012), Laser-Assisted Simultaneous Patterning and Transferring of Graphene. *J. Phys. Chem. C*, 121224065306002.

- [23] Compagnini, G., Sinatra, M., Russo, P., Messina, G. C., Puglisi, O., & Scalese, S. (2012), Deposition of Few Layer Graphene Nanowalls at the Electrodes During Electric Field-Assisted Laser Ablation of Carbon in Water. *Carbon*, 50(6), 2362-2365.
- [24] Hong, J., Kang, Y. S., & Kang, S. W. (2011), Nanoassembly of Block Copolymer Micelle and Graphene Oxide to Multilayer Coatings. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 50(6), 3095-3099.
- [25] Eda, G., Fanchini, G., & Chhowalla, M. (2008), Large-Area Ultrathin Films of Reduced Graphene Oxide as a Transparent and Flexible Electronic Material. *Nat. Nanotechnol.*, 3(5), 270-274.
- [26] Chen, H., Muller, M. B., Gilmore, K. J., Wallace, G. G., & Li, D. (2008), Mechanically Strong, Electrically Conductive, and Biocompatible Graphene Paper. Adv. Mater., 20, 3557–3561.
- [27] Wang, S. J., Geng, Y., Zheng, Q., & Kim, J. K. (2010), Fabrication of Highly Conducting and Transparent Graphene Films. *Carbon*, 48(6), 1815-1823.
- [۲۸] قنبری، ه.، صراف مأموری، ر.، صباغ زاده، ج.، ملک فـر، ر.، جعفرخـانی، پ.، دادرس، س، ترکمنـی، م. ج. (۱۳۹۰)، سـنتز نانوورقه های گرافن به کمک لیزر Nd:YAG در حلالها آلی از گرافیت صنعتی، ارائه شده در هشتمین کنگره سـرامیک ایران، تهران.
- [29] Ghanbari, H., Mamoory, R. S., Sabbaghzadeh, Malekfar, R. (2011), Laser-Assisted Production of Graphene Nanosheets in Nmp and 1-Propanol from Industrial Graphite. Paper presented at the 22nd European Conference on Diamond, Diamond-like materials, carbon nanotubes and nitrides, Garmisch-Partenkirchen, Germany.
- [۳۰] قنبری، ه.، صراف ماموری، ر.، صباغزاده، ج.، و ملکفر، ر. (۱۳۹۲)، بررسی ساختاری محصولات کندوسوز لیـزری ورقـه گرافیت صنعتی در محیط ۱-پروپانول و سنتز گرافن چندلایه از آن. ارائه شده در نهمین کنگره سرامیک ایران، تهران.
- [31] Andersson, O. E., Prasad, B. L. V., Sato, H., & Enoki, T. (1998), Structure and Electronic Properties of Graphite Nanoparticles. *Phys. Rev. B: Condens. Matter*, 58(24), 16387-16395.
- [32] Novoselov, K. S., Morozov, S. V., Mohinddin, T. M. G., Ponomarenko, L. A., Elias, D. C., Yang, R., Barbolina, I. I., Blake, P., Booth, T. J., Jiang, D., Giesbers, J., Hill, E. W., & Geim, A. K. (2007), Electronic Properties of Graphene. *Phys. Status Solidi (B), 244*(11), 4106-4111.
- [33] Kang, J., Bang, J., Ryu, B., & Chang, K. J. (2008), Effect of Atomic-Scale Defects on the Low-Energy Electronic Structure of Graphene: Perturbation Theory and Local-Density-Functional

Calculations. Phys. Rev. B: Condens. Matter, 77(11).

[34] Caetano, E. W. S., Freire, V. N., Dos Santos, S. G., Albuquerque, E. L., Galvao, D. S., & Sato,
 F. (2009), Defects in Graphene-Based Twisted Nanoribbons: Structural, Electronic, and Optical
 Properties. *Langmuir*, 25(8), 4751-4758.